

Maximize Performance of ZEISS Microscope with Latest imaging Technic

【日時】 2018/10/25 (木) 13:00-17:00

【場所】 九州大学伊都キャンパス・工学部第4講義室 (西講義棟3階)

【主催】 九州大学中央分析センター

【共催】 九州大学ナノテクノロジープラットフォーム

【協力】 カールツァイス株式会社

13:00-13:50 最新FE-SEMの基礎から材料解析アプリケーションに至るご紹介

カールツァイス株式会社 藤谷 洋

ZEISS独自のGEMINI技術を用いた最新FE-SEMの電子光学系と信号検出原理について詳しく説明しながら、金属・高分子等の材料について観察・分析事例をご紹介します。

13:50-15:00 走査電子顕微鏡でここまでわかる

～ 信号アクセプタンス制御による情報最大化 ～

JFEテクノロジー株式会社 佐藤 馨

最新のSEMは低加速電圧での解像度向上に加え、二次電子検出器と反射電子検出器を複数搭載し多様な情報を与えてくれる。材料の組織解析情報を最大化する上で、加速電圧と作動距離を制御した像の取得が必須である。この信号アクセプタンスの“sweet spot”を事例に基づき紹介する。

15:10-16:00 高分解能X線顕微鏡の基礎原理と応用事例のご紹介

～非破壊による試料の高精細X線透過観察について～

カールツァイス株式会社 速水 信弘

X線顕微鏡はこれまでのマイクロフォーカスX線CTよりも高分解能で3D情報を観察するトモグラフィ技術です。CTの原理と注意点、X線顕微鏡技術の電池・エネルギー材料をはじめとした応用例と最新技術情報のご紹介をします。

16:00-16:50 電子顕微鏡用EDS・EBSDをはじめとした最新材料解析ツールのご紹介

オックスフォードインスツルメンツ株式会社 森田 博文

電子顕微鏡へ装着するEDS (エネルギー分散X線元素分析装置)、学内でもお馴染みのEBSD (電子線結晶方位解析装置) の基礎から最新の各種アプリケーションデータまでを特に「ハイスピード・解析の高効率化」をテーマに検出技術・解析事例を交えて報告します。

16:50-17:00 質疑応答

最新の各種顕微鏡技術とイメージング技術に関して解説します。
学内外どなたでもご参加できます。事前の参加登録にご協力をお願いします。

【問合せ・申込先】

九州大学中央分析センター伊都分室 渡辺 TEL092-802-2857
watanabe.midori.452@m.kyushu-u.ac.jp